

マイクロナノ2006・マイクロマシン展開催結果報告

平成18年度より総合イベント「マイクロナノ2006・第17回マイクロマシン展」を、東京国際フォーラム(有楽町)を主会場として実施しました。

マイクロナノ2006は、11月6日から11月9日までMEMS標準化国際ワークショップ、MEMSフォーラム、国際マイクロマシン・ナノテクシンポジウム及びMEMS-ONE成果発表会が行われ、いずれの会場も予定数を超える関係者が参加された。一方、マイクロマシン展は11月7日から11月

9日まで開催され、これまでの入場者記録(前回9,098名 今回11,736名)を2,638名更新した。なお、今回は「第10回化学・生命科学マイクロシステム国際会議」(μTAS2006)が同時開催(11月5日~11月9日)され、相乗効果もあいまって盛況裡に終了することができました。それぞれの詳細報告は次のとおりです。ご協力いただきました関係者の皆様には、厚く御礼申し上げます。

(マイクロナノ2006・マイクロマシン展事務局)

H18 MEMS国際標準化ワークショップ

The 2nd Workshop on Characterization of Materials for MEMS / MST Devices

MEMSはセンサーからマンマシンインターフェースや医療、自動車産業からITやAVなど多くの分野に用いられる世界的な先端成長産業となってきましたが、一方では世界共通の標準が殆ど無い分野でもあり、産業発展の大きな障害の一つとなっています。

そこでMMCでは世界的に先端的かつ優れた成果を出している研究者を招聘し、MEMSに関するマイクロ/ナノ技術と評価の最前線を講演して頂くとともに国際標準制定に向けた各国との意見交換・相互理解を深めることを目的としたワークショップを11月6日(月)、東京・三菱ビルにて開催致しました。

ワークショップは肥後実行委員長(東京工業大学・教授)の開会挨拶ではじまり、<MEMSデバイスの最前線>、<MEMS評価法と標準化>の2つセッションに分かれ、欧州(3件)、北米(2件)、韓国(2件)、日本(1件)から計8件の講演が行われ、企業や大学・研究機関からの参加者ならびに関係者、約80名が熱心に耳を傾けていました。講演者は発表順に以下の通りです。

<MEMSデバイスの最前線>

- ・韓国 Kyunpook National Univ. Park教授
- ・スイス ETH Zurich Hierold教授
- ・スイス EPFL Brugger教授

<MEMS評価法と標準化>

- ・韓国 KRISS(標準科学研究所) Huh博士
- ・ドイツ Freiburg大 Paul教授
- ・米国 Pennsylvania州立大 Muhlstein教授
- ・日本 熊本大 高島教授
- ・米国 California州大Berkeley校 Ritchie教授

今回のワークショップでは、マイクロ/ナノスケールの材料特性評価を中心とした第一線の研究者が集う貴重な機会となりましたが、中でも韓国から標準化に関連した2名の研究者と意見交換を行うことができたことは今後の国際的なネットワーク作りという観点からは大きな意義があったと思われます。

また欧米の関連研究者に対しても我が国が進めている標準化活動に対して理解を得られたことは大きな成果であり、今後の国際標準化活動の大きな指針となりました。



写真1 ワークショップ会場 写真2 講演者およびワークショップ関係者

第17回マイクロマシン展成功裏に終わる

第17回マイクロマシン展が、11月7日~9日の3日間、東京国際フォーラム(東京・有楽町)において開催され、地の利と天候にも恵まれ大盛況で終了いたしました。

今回のテーマは「超精密・微細加工、MEMS、ナノテク、バイオに関する国際展示会」としました。

出展者は、財団法人マイクロマシンセンターの賛助会員企業13社、MEMS協議会アソシエイト会員8社をはじめ、一般企業、大学及び独立行政法人等からの積極的な出展協力を得て、過去最大の合計313の企業・団体・大学・研究機関が出展(429小間)しました。海外からは19企業が出展しました。

来場者も、3日間で過去最大の11,736名に上る多数の来場者を得て盛況裡に終了しました。

なお、来年は会場を東京ビッグサイトに移して開催いたします。

次回第18回マイクロマシン/MEMS展の開催予定

会期: 2007年7月25日(水)~7月27日(金)
会場: 東京ビッグサイト(東京・有明)

